

A Plasma-LIITS ENTREGA Fonte Pulsante de Tensão Plasma-LIITS PS.

A Plasma-LIITS entregou para grupo da UNICAMP uma fonte pulsante de tensão para polarizar o substrato durante a deposição de filmes de carbono altamente tetraédricos. A fonte é usada como indicado no esquema abaixo. A fonte **Plasma-LIITS PS** é um conversor de tensão contínua em tensão pulsada especialmente desenhado para operar como pulsante da tensão de polarização do porta substrato de um sistema FCVA (*Filtered Cathodic Vacuum Arc*). O conversor opera com chaves semicondutoras de última geração.

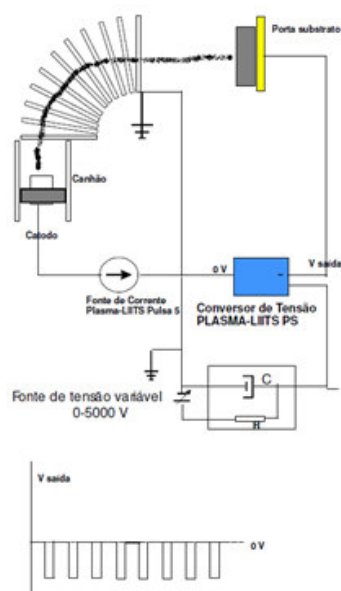


Diagrama do Conversor de Tensão pulsada Plasma-LIITS integrando no sistema de deposição de filmes de carbono altamente tetraédricos.

As características principais da fonte são:

- Alimentação 127 Vac +/-10%, 60 Hz
- Tensão contínua de entrada 0 -800 V.
- Tensão de saída pulsada variável de 0 -800 V pico.
- Frequência de pulso ajustável continuamente entre 1-20 kHz.
- Ciclo de trabalho ajustável continuamente entre 0-100%
- Controle manual da frequência e ciclo de trabalho.
- Indicação digital de frequência do conversor.
- Indicação digital de ciclo de trabalho.
- Manual de operação e manutenção.